

Objectif WLI 50X Olympus

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Produkt #91-174 NEU 2 In Stock

-

1

+

€9.960⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€9.960,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
WLI50XMRTC	Modellnummer:
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	Typ:
Infinity Corrected	Art:

Olympus	Hersteller:
Designed to be used with a 180mm Tube Lens, Sold Separately	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.44	Bildfeld (mm):
44.00	Länge ohne Gewinde (mm):
31.5	Max. Durchmesser (mm):

Optische Eigenschaften

3.60	Brennweite BW (mm):
50X	Vergrößerung:
0.8	Numerische Apertur NA:
0.42	Auflösung (µm):
0.43	Tiefenschärfe (µm):
1	Arbeitsabstand (mm):
22	Feldzahl:
45	Parfokallänge (mm):
1074.2	Abbildungstiefe (µm):

Gewinde & Montage

RMS / 20.32mm x 36 TPI	Gewinde:
------------------------	----------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kombination aus hoher numerischer Apertur und breitem Bildfeld
 - Thermische Kompensation & Stabilitätsmerkmale
 - Geeignet für 3D-Oberflächenmesstechnik und -profilometrie
- Das fortschrittliche optische Design der unendlich korrigierten WLI-Interferometrie-Objektive von Olympus vereint eine hohe numerische Apertur mit einem breiten Bildfeld, wodurch feine Oberflächendetails über große Bereiche hinweg klar und deutlich zu erkennen sind. Jedes Objektiv verfügt über einen eingebauten Einstellring, der temperaturbedingte Fokusverschiebungen ausgleicht und so Stabilität und gleichbleibende Messgenauigkeit auch unter instabilen Umgebungsbedingungen gewährleistet. Diese Objektive sind für die Verwendung mit einer Tubuslinse mit 180 mm Brennweite konzipiert und in Vergrößerungsstufen von 10 bis 50X erhältlich. Die unendlich korrigierten WLI-Objektive von Olympus eignen sich ideal für die 3D-Oberflächenmesstechnik und Profilometrie, einschließlich Halbleiterinspektion, Präzisionsbearbeitung, Bewertung optischer Beschichtungen und mikroelektronischer Charakterisierung.